

Cesta De Limpieza De Obleas Cuadradas De Ptfе, Bastidor De Grabado De Semiconductores De Fluoropolímero, Portador Obleas De Silicio Personalizado

Número de artículo: PL-CP89



Introducción

Optimice los procesos de bancos húmedos de semiconductores con nuestras cestas de limpieza de obleas cuadradas de PTFE personalizadas. Diseñadas para una resistencia química extrema y un manejo de alta pureza, estos portadores de fluoropolímero ofrecen una durabilidad y precisión superiores para la grabación y limpieza crítica de obleas de silicio.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio clave
Grabado de obleas de silicio	Inmersión del sustrato en grabadores ácidos para eliminar capas superficiales o crear texturas específicas.	Resistencia excepcional a mezclas de HF y ácido nítrico.
Limpieza de células solares	Limpieza de múltiples etapas de obleas fotovoltaicas cuadradas de gran formato antes del dopaje o recubrimiento.	Capacidad de manejo de alto volumen con roturas mínimas.
Procesamiento MEMS	Manejo de sistemas microelectromecánicos durante pasos críticos de liberación química.	El entorno de alta pureza previene la contaminación microscópica.
Limpieza ultrasónica	Uso dentro de baños de ultrasonidos para eliminar partículas submicrónicas de óptica de precisión o electrónica.	Las propiedades de amortiguación protegen las piezas delicadas de daños por vibración.
Análisis de metales traza	Preparación y limpieza de material de laboratorio en baños de ácido de alta pureza para química analítica.	La menor interferencia de fondo posible para la detección a nivel PPB.
Manejo de sustratos LED	Soporte para obleas de zafiro o carburo de silicio a través de ciclos agresivos de limpieza y enjuague.	Fiabilidad a largo plazo en procesos químicos de alta temperatura.
Almacenamiento y transporte químico	Contención segura de sustratos sensibles durante el tránsito entre módulos de salas limpias.	Las superficies no reactivas protegen la química de la superficie de la oblea.
Investigación de laboratorio	Portador de tamaño personalizado para el procesamiento de materiales experimentales en laboratorios universitarios y de I+D.	Diseño adaptable para ajustarse a configuraciones experimentales no estándar.

Categoría de especificación	Detalles del parámetro para PL-CP89
Identificación del modelo	PL-CP89
Dimensiones estándar	249mm x 249mm (Configuración cuadrada)
Composición del material	100% PTFE de alta pureza (Politetrafluoroetileno)
Compatibilidad química	Universal (Excepto metales alcalinos fundidos y flúor elemental)
Rango de temperatura	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Método de fabricación	Mecanizado CNC completo a partir de lingote sólido
Capacidad de obleas	Totalmente personalizable (Cuenta de ranuras y paso variables)

Aplicación	Descripción	Beneficio clave
Categoría de especificación	Detalles del parámetro para PL-CP89	
Ancho de ranura	Mecanizado de precisión (Personalizable según el espesor de la oblea)	
Características de drenaje	Puertos de flujo integrados en la base y los lados para el intercambio de fluidos	
Opciones de mango	Mangos de PTFE desmontables o integrados opcionales disponibles	
Acabado superficial	Acabado mecanizado liso y no poroso para evitar la atrapamiento de partículas	
Cumplimiento	Cumple con RoHS, materias primas de grado FDA	